^{13.1;13.2} Фотоэдс на поверхности сильнолегированного *p*⁺-GaAs с адсорбированными слоями цезия и кислорода

© В.С. Хорошилов^{1,2}, Д.М. Казанцев^{1,2}, С.А. Рожков^{1,2}, В.Л. Альперович^{1,2}

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия ² Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия E-mail: alper_v@mail.ru

Поступило в Редакцию 7 августа 2023 г. В окончательной редакции 15 сентября 2023 г. Принято к публикации 15 сентября 2023 г.

Разработана новая методика измерения поверхностной фотоэдс, основанная на зависимости квантового выхода фотоэмиссии от величины изгиба зон. С помощью этой методики изучена эволюция фотоэдс в сильнолегированном p^+ -GaAs ($6 \cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}$) при адсорбции цезия и кислорода. Обнаружены обратимые изменения величины фотоэдс, которые качественно отличаются от наблюдавшихся ранее на слаболегированных образцах и объясняются вариациями скорости поверхностной рекомбинации при формировании и распаде двумерных цезиевых кластеров.

Ключевые слова: фотоэмиссия, поверхностная фотоэдс, GaAs, фотолюминесценция, отрицательное электронное сродство.

DOI: 10.61011/PJTF.2023.21.56460.19703

Известно, что адсорбция цезия и кислорода на поверхности сильнолегированного p^+ -GaAs позволяет достичь состояния с эффективным отрицательным электронным сродством (ОЭС) $\chi^* = \chi - \varphi_S \approx -0.2 \, \text{eV}$, где χ — истинное сродство, φ_S — поверхностный изгиб зон. Это состояние обеспечивает высокий квантовый выход фотоэмиссии из p^+ -GaAs(Cs,O)-фотокатодов [1]. Захват фотоэлектронов на поверхностные состояния приводит к возникновению фотоэдс V, т.е. уменьшению изгиба зон за счет частичной экранировки поверхностного электрического поля [2]. Фотоэдс увеличивает эффективное сродство χ^* и, как следствие, уменьшает квантовый выход ОЭС-фотокатодов, в особенности при освещении мощными лазерными импульсами [3]. В связи с этим измерение фотоэдс на поверхности p^+ -GaAs(Cs,O) представляет интерес для изучения влияния процессов поверхностного захвата и рекомбинации электронов на фотоэмиссию.

Ранее эволюция фотоэдс при адсорбции цезия и кислорода на поверхности *p*-GaAs изучалась методом спектроскопии фотоотражения на образцах с умеренным уровнем легирования ($p \approx 1.5 \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$) и на специальных UP⁺-структурах с тонким (30–100 nm) нелегированным поверхностным слоем [4,5]. Было показано, что при последовательном нанесении слоев Cs и O₂ адсорбция Cs приводит к увеличению величины фотоэдс V, а адсорбция O₂ — к ее уменьшению. Такое поведение было объяснено экспоненциальной зависимостью $V(\varphi_S)$ [6] и адатом-индуцированными вариациями изгиба зон: при нанесении Cs φ_S увеличивается благодаря формированию и зарядке Cs-индуцированных поверхностных состояний, а при нанесении O₂ уменьшается из-за "пассивации" этих состояний. На по-

верхности сильнолегированного p^+ -GaAs(Cs,O) с характерным для OЭC-фотокатодов уровнем легирования $p \ge 5 \cdot 10^{18}$ cm⁻³ спектроскопия фотоотражения оказалась неприменимой ввиду недостаточной чувствительности метода [6], поэтому вопрос об эволюции фотоэдс на такой поверхности при адсорбции цезия и кислорода оставался открытым. В настоящей работе для выяснения этого вопроса разработана новая, более чувствительная методика измерения фотоэдс, основанная на влиянии изгиба зон на квантовый выход фотоэмиссии. Обнаруженное с помощью этой методики поведение величины фотоэдс качественно отличается от наблюдавшегося ранее.

Эксперименты проводились на образцах p^+ -GaAs(001), выращенных методом жидкофазной эпитаксии и легированных цинком до уровня $p \approx 6 \cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}$. Атомарно-чистые Ga-обогащенные химическим поверхности получались удалением оксидов в атмосфере азота и прогревом в вакууме при температуре 760 К [7]. Нанесение Cs и O_2 и все измерения проводились при комнатной температуре (T = 295 K) в вакуумной камере с базовым давлением 10^{-8} Ра (рис. 1). Поверхность образца освещалась двумя пучками света 1 и 2 с одинаковой длиной волны $\lambda_1 = \lambda_2 = 850 \,\mathrm{nm}$ и интенсивностями $P_1 \approx 0.1 \,\mathrm{mW/cm^2}$ и $P_2 \approx 1 \,\mathrm{mW/cm^2}$, модулированными на частотах $f_1 = 80$ Hz и $f_2 = 1030$ Hz. Каждый пучок генерировал ток фотоэмиссии J_{1.2}, а также поверхностную фотоэдс $V_{1,2}$. Влияние фотоэдс на эффективное сродство χ^* и, как следствие, на квантовый выход фотоэмиссии приводило к возникновению на суммарной и разностной частотах $f_2 \pm f_1$ фотоэдс-индуцированного фототока ΔJ , амплитуда ΔJ и фаза φ которого измерялись



Lock-in detectors

Рис. 1. Схема установки. I, 2 — пучки света, модулированные по интенсивности частотами $f_{1,2}$. Ток фотоэмиссии J_1 и фотоэдсиндуцированный фототок ΔJ измеряются системой синхронных детекторов LD_{1-3} .



Рис. 2. Эволюция тока фотоэмиссии J_1 (1), фотоэдсиндуцированного фототока ΔJ (2) и поверхностной фотоэдс V_2 (3) при адсорбции цезия на чистой поверхности p^+ -GaAs. Длина волны излучения равна 850 nm.

путем последовательного синхронного детектирования сигналов на частотах f_2 и f_1 .

Фототок ΔЈ является суммой двух компонент, соответствующих взаимному влиянию пучков 1 и 2: модуляции тока фотоэмиссии J₁ за счет фотоэдс V₂ и модуляции J₂ за счет V₁. Для расчета фотоэдс использовалась экспоненциальная зависимость квантового выхода У от электронного сродства χ^* , справедливая для фотонноусиленной эмиссии термализованных электронов из *p*⁺-GaAs с положительным электронным сродством (ПЭС) при $\lambda_1 = \lambda_2 = 850 \text{ nm}$ [8]: $Y \propto \exp(-\chi^*/kT)$, где k — постоянная Больцмана. Предполагалось также, что фотоэдс мала $(V_{1,2} \ll kT/e, e$ — заряд электрона) и поэтому линейно зависит от интенсивности P_{1.2} [6]. В таком случае выбор одинаковых длин волн $\lambda_1 = \lambda_2$ обеспечивал равенство эффектов взаимовлияния пучков 1 и 2, так как амплитуды этих эффектов пропорциональны произведениям J_1V_2 и J_2V_1 , каждое из которых определяется произведением интенсивностей P₁P₂. В результате фотоэдс V2 рассчитывалась по формуле

$$V_2 = \frac{kT}{e} \frac{\Delta J}{J_1} \frac{\pi}{4\cos\varphi}.$$
 (1)

Характерное время релаксации фотоэдс τ определялось с помощью соотношения $\tan 2\varphi = 2\pi f_2 \tau$.

На рис. 2, *а* показана зависимость тока фотоэмиссии J_1 и фотоэдс-индуцированного фототока ΔJ от цезиевого покрытия θ (в монослоях, ML) при адсорбции на



Рис. 3. Эволюция тока фотоэмиссии $J_1(I)$, фотоэдс-индуцированного фототока $\Delta J(2)$, их отношения $\Delta J/J_1(3)$ и интенсивности фотолюминесценции $I_{PL}(4)$ при нанесении цезия и кислорода на поверхность p^+ -GaAs. Серым цветом выделены участки нанесения кислорода. Темным кружкам соответствуют моменты "включения", а светлым — "выключения" кислорода.

поверхности p^+ -GaAs. Фототок J_1 растет с увеличением θ и, как известно, достигает максимального значения при $\theta = 0.5$ ML, когда сродство χ^* минимально [1,8]. Максимум ΔJ наблюдается при меньших θ и определяется зависимостью $V_2(\theta)$. Величина фотоэдс V_2 (рис. 2, *b*) рассчитывалась из отношения $\Delta J/J_1$ по формуле (1). Видно, что V_2 монотонно уменьшается с нанесением цезия. Во всем диапазоне $\theta = 0.2-0.5$ ML фаза сигнала ΔJ составляла $\varphi \approx 7^{\circ}$, что соответствует времени релаксации фотоэдс $\tau \approx 40 \, \mu$ s.

В дальнейшем, после достижения $\theta = 0.5$ ML, нанесение цезия на поверхность продолжилось, и в дополнение к этому производилось периодическое нанесение кислорода [1,5] (рис. 3). Из рис. 3, *а* видно, что ток фотоэмиссии J₁ в каждом цикле нанесения Cs и O₂ ведет себя немонотонно, но в целом возрастает благодаря снижению эффективного электронного сродства до состояния с ОЭС [1]. Эволюция фотоэдс-индуцированного фототока также немонотонна: ΔJ уменьшается после нанесения цезия и увеличивается после нанесения кислорода. В случае ОЭС воспользоваться формулой (1) для определения абсолютной величины фотоэдс V_2 нельзя, так как при переходе от ПЭС к ОЭС экспоненциальная зависимость $Y(\chi^*)$ сменяется линейной [9]. Однако для малой фотоэдс $V_2 \ll kT/e$ отношение $\Delta J/J_1$ остается пропорциональным величине V_2 , поэтому эволюция $\Delta J/J_1$, показанная на рис. 3, *b*, отражает относительные вариации фотоэдс. Видно, что фотоэдс уменьшается после нанесения цезия и увеличивается после нанесения кислорода.

Такое поведение качественно отличается от ранее наблюдавшегося на образцах с умеренным уровнем легирования [4], а также на UP⁺-структурах [4,5], где максимум фотоэдс наблюдался, наоборот, после нанесения цезия. Это различие может быть объяснено формированием двумерных металлических цезиевых кластеров на поверхности GaAs [10], которые приводят к увеличению скорости поверхностной рекомбинации и, как следствие, к уменьшению плотности фотоиндуцированного поверхностного заряда и величины фотоэдс [2]. В свою очередь нанесение кислорода разрушает Сs-кластеры [10] и увеличивает фотоэдс. Отметим, однако, что направление и амплитуда вариаций фотоэдс зависели от предыстории поверхности p-GaAs(Cs,O). Приведенные на рис. 2 и 3 данные получены после многократных циклов нанесения и термодесорбции (Cs,O)-покрытия, причем фотоэдс возрастала с номером цикла. Причины сложного поведения фотоэдс остаются невыясненными и могут быть связаны с окислением поверхности GaAs или неполным термическим удалением (Cs,O)-слоев.

Изменения скорости поверхностной рекомбинации, вызванные формированием и разрушением Сs-кластеров, можно зарегистрировать с помощью измерения интенсивности фотолюминесценции I_{PL} [11]. На рис. 3, *с* показана эволюция I_{PL} , измеренная в отдельном эксперименте при освещении поверхности p^+ -GaAs лазером с длиной волны 650 nm. Видно, что I_{PL} уменьшается при нанесении цезия, что свидетельствует о росте скорости поверхностной рекомбинации и качественно согласуется с приведенным объяснением. Отметим, что амплитуда вариаций I_{PL} (~ 1%) существенно меньше, чем для $\Delta J/J_1$ (~ 25%), что, вероятно, обусловлено доминирующим влиянием объемной рекомбинации (по сравнению с поверхностной) на интенсивность фотолюминесценции.

Мы полагаем, что изменение направления обнаруженных вариаций фотоэдс по отношению к наблюдавшимся ранее [4,5] вызвано наличием двух конкурирующих механизмов, определяющих величину фотоэдс при адсорбции цезия и кислорода, а именно вариаций изгиба зон и скорости поверхностной рекомбинации. Вариации изгиба зон $\Delta \varphi_S$ зависят от уровня легирования через ширину области поверхностного поля $w: \Delta \varphi_S \propto w \Delta Q_S$,

где ΔQ_S — адатом-индуцированное изменение заряда поверхности. При одинаковом ΔQ_S величина $\Delta \varphi_S$ в образцах p^+ -GaAs ($p \approx 6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $w \approx 10 \text{ nm}$) в несколько раз меньше, чем в умеренно легированных ($p \approx 1.5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $w \approx 60 \text{ nm}$) [4] и UP+-структурах ($w \approx 30-100 \text{ nm}$) [5]. Поэтому на фоне ослабленных вариаций изгиба зон на поверхности p^+ -GaAs доминирующее влияние на фотоэдс может оказывать скорость поверхностной рекомбинации.

В заключение отметим, что с помощью новой методики, основанной на зависимости тока фотоэмиссии от изгиба зон, изучена эволюция фотоэдс на поверхности сильнолегированного p^+ -GaAs (6 · 10¹⁸ cm⁻³) при адсорбции цезия и кислорода. Обнаружены обратимые изменения фотоэдс между малой величиной после адсорбции цезия и большой после адсорбции кислорода. Такие вариации фотоэдс противоположны наблюдавшимся ранее на структурах с меньшим уровнем легирования и объясняются изменениями скорости поверхностной рекомбинации, предположительно связанными с формированием и распадом цезиевых кластеров.

Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-72-30003 (https://rscf.ru/project/23-72-30003/).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Р.Л. Белл, Эмиттеры с отрицательным электронным сродством (Энергия, М., 1978), с. 84–102. [R.L. Bell, Negative electron affinity devices (Clarendon, Oxford, 1973), p. 65–76].
- [2] L. Kronik, Y. Shapira, Surf. Sci. Rep., 37, 1 (1999).
 DOI: 10.1016/S0167-5729(99)00002-3
- [3] A. Herrera-Gómez, G. Vergara, W.E. Spicer, J. Appl. Phys., 79, 7318 (1996). DOI: 10.1063/1.361448
- [4] V.L. Alperovich, A.G. Paulish, A.S. Terekhov, Phys. Rev. B, 50, 5480 (1994). DOI: 10.1103/PhysRevB.50.5480
- [5] V.L. Alperovich, A.G. Paulish, H.E. Scheibler, A.S. Terekhov, Appl. Phys. Lett., 66, 2122 (1995). DOI: 10.1063/1.113923
- [6] H. Shen, M. Dutta, J. Appl. Phys., 78, 2151 (1995). DOI: 10.1063/1.360131
- [7] O.E. Tereshchenko, V.L. Alperovich, A.G. Zhuravlev, A.S. Terekhov, D. Paget, Phys. Rev. B, 71, 155315 (2005).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.71.155315
- [8] A.G. Zhuravlev, A.S. Romanov, V.L. Alperovich, Appl. Phys. Lett., 105, 251602 (2014). DOI: 10.1063/1.4904986

- [9] L.B. Jones, H.E. Scheibler, S.N. Kosolobov, A.S. Terekhov, B.L. Militsyn, T.C.Q. Noakes, J. Phys. D: Appl. Phys., 54, 205301 (2021). DOI: 10.1088/1361-6463/abe1e9
- [10] C. Laubschat, M. Prietsch, M. Domke, E. Weschke, E. Remmers, T. Mandel, E. Ortega, G. Kaindl, Phys. Rev. Lett., 62, 1306 (1989). DOI: 10.1103/PhysRevLett.62.1306
- [11] T. Kanata, M. Matsunaga, H. Takakura, Y. Hamakawa, T. Nishino, J. Appl. Phys., 68, 5309 (1990).
 DOI: 10.1063/1.347023